3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成21年７月27日から平成21年８月27日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　その他
この導入計画の詳細は導入説明書による。
なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
5　Summary
⑴　Classification of the services to be procured : 71, 27
⑵　Nature and quantity of the services to be required : Hospital infomation system 1 set
⑶　Type of the procurement : Lease
⑷　Basic requirements of the procurement : Details depend on the introduction manual.
⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M August 27, 2009
⑹　Contact point for the notice : Mario Yago, Director, Accounting Division, National Hospital Organization Fukuyama Medical Center 4―14―17, Okinogami-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken 720―8520, Japan. TEL 084―922―0001 ext. 1310

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成21年７月27日
国立大学法人東北大学理事　植木　俊哉
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　04
○第16号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　導入計画物品及び数量
イメージング分解複合型ＸＰＳ　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期
平成21年度12月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　アナライザーの形式は静電半球型アナライザーで、アナライザー半径165㎜以上の大型アナライザーを有すること。
B　ローランド径500㎜の大型モノクロメータＸ線銃を搭載しており、スペクトルの高エネルギー分解能測定（試料銀Ag３ｄ５／２ピークの半値全幅0.45eV以下）が可能であること。
C　空間分解能３μｍ以下のイメージング機能を有し、測定画素は256×256以上で、最大イメージング範囲は５㎜×５㎜以上であること。またイメージ測定は１ｓ以上の積算で取得可能であること。
D　アナライザーのエネルギースイープを行わないスペクトル測定が可能であること。また、15eV以上のエネルギー範囲について0.1秒以上で、0.2eVステップ以下のスペクトルを測定可能であること。
E　マイクロスペクトル分析機能は、Ｘ線源によらず可能であること。最小分析径は15μｍ以下であること。
F　コンピュータ表示されているイメージデータ上で測定点を指定し、サンプルを移動せずに多点を自動分析するマルチポイント分析機能を有すること。
G　分析室内にエッチングイオン銃を搭載し、その形式は中性粒子除去機構付低エネルギー差動排気型フローティングイオン銃であること。また多原子イオンを使用した場合、有機物に対して試料損傷の少ないスパッタデプスプロファイリングを可能とする機能を有すること。
H　絶縁物試料の帯電中和機構として、均一電子中和機構を装備していること。
I　ＵＶ光源を搭載し、ＨｅⅠまたはＨｅⅡ励起光により紫外光分光測定機能を有すること。
J　フィールドエミッション型の電子銃を搭載し、オージェ分光測定機能を有すること。
K　分析室内において、試料加熱冷却機能を有すること。
L　予備排気室において、試料加熱冷却機能を有すること。
M　予備排気室において、試料ガス反応室機能を有すること。
N　グローブボックス等で調製された試料を大気に曝すことなく、装置本体に導入できる機能を有すること。
O　試料測定中に試料の交換を可能とする機能を有すること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成21年８月27日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒980―8577　仙台市青葉区片平２―１―１　東北大学財務部資産・調達管理課調達管理第二係長　芳賀　昌史　電話022―217―4869
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成21年７月27日から平成21年８月27日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成21年８月３日15時00分
⑵　開催場所　東北大学工学部・工学研究科管理棟１Ｆホール
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 24
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Hybrid XPS system with imaging resolution 1 Sets
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The electron energy analyser should be an electrostatic hemispherical analyser with the mean radius equal to or larger than 165 ㎜.
B　The instrument should be equipped with a large backplane X-ray monochromator with Rowland circle diameter of 500 ㎜. A high energy resolution spectrum, with FWHM of less or equal to 0.45 eV for Ag 3d5／2 peak from a pure silver sample, should be achievable.
C　An XPS imaging capability with lateral resolution of less or equal to 3 microns should be provided. The number of imaging pixels should be equal to or larger than 256×256, and the maximum imaging area should be equal to or larger than 5×5 ㎜. An XPS image should be acquired with acquisition time equal to or longer than 1 second.
D　A spectrum without sweeping the energy of the analyser should be achievable. In this case, a spectrum with energy range equal to or larger than 15 eV, with energy step equal to or smaller than 0.2 eV, should be achievable within 0.1 second or longer acquisition time.
E　Means to acquire a small spot selected area spectrum should be provided irrespective of the type of the X-ray source. The smallest spot size should be equal to or smaller than 15 microns in diameter.
F　A Multipoint Analysis capability which enables analysis positions of small spot selected area spectrum analysis to be defined from an XPS image displayed on the computer screen should be provided. In this capability, after completing the definition of analysis positions, it should be possible to acquire multiple spectra automatically from different analysis positions without transferring the specimen.
G　The instrument should be equipped with an ion source for sputter etching, a differentially pumped floating lens column type ion gun with means to remove neutral atoms. When polyatomic ion is used, the ion source should provide a capability to enable sputter depth profiling measurement without giving a significant damage to organic materials on the specimen.
H　The instrument should be equipped with a uniform electron charge neutraliser system for the purpose of neutralising the charging effect on insulating samples.
I　An ultraviolet light source, which provides a capability to perform an ultraviolet photoelectron spectroscopy measurement by using He (I) or He (II) light source, should be provided.